

マイクロ波CVD装置 SDM-2



マイクロ波CVD装置SDM-2はマイクロ波CVDによるダイヤモンド薄膜の試験製造装置。シリコンウエハ上に直径10mm程度、厚み10 μ 以上のダイヤモンド膜を成膜できます。

マイクロ波CVD装置 SDM-2 仕様

- チャンバー排気系:
チャンバー・ロータリーポンプ・排気コントロールシステム・排気バルブ・リークバルブ・配管
- ガス導入系:
マスフロー・フローメーター・ストップバルブ・フィルター・チェックバルブ・コントロールバルブ
継手・配管・プレッシャースイッチ
- エア導入系:
ソレノイドバルブ・レギュレーター・圧力スイッチ・継手・配管
- 水挿入系:
マニホールド・フローチェッカー・バルブ・継手・チューブ
- 電源系:
マイクロ波電源 2.45GHz/3kW
- 計測系:
ピラニ真空計
- 基板系:
ヒーター基板(空冷/水冷付)・ヒーターコントローラー・上下機構・測長